



OPTIKA[®]
MICROSCOPES
I T A L Y

IM-5MET

OPTIKA Microscopes представляет новый инвертированный микроскоп IM-5MET для металлографических исследований, обеспечивающий всеобъемлющее решение в области материаловедения для достижения наилучших результатов.

ECO

IM-5MET

Сверхширокоугольные окуляры PL 10x с F.N. of 24 mm

Ручка для переноски

Крепкий, конфигурируемый корпус

Тринокулярный порт с распределением света (100/0, 0/100)

Выбор СП/ТП
Светлое поле,
Темное поле

Крупный коаксиальный механизм фокусировки (Градуированный, 0.002 мм)

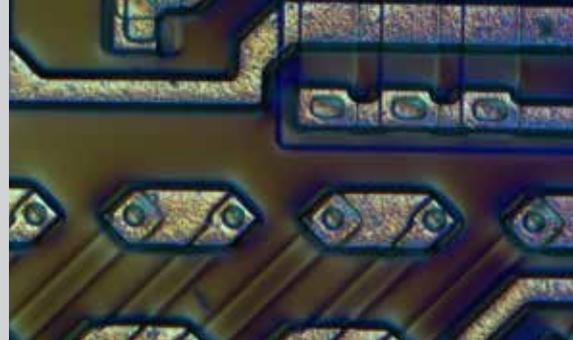
Безрамная механическая подставка (240 x 250 мм) с двойным штенгельциркулем и поверхностью, устойчивой к царапинам

Выбор между двумя сериями объективов (BF and DF или только BF) с антигрибковой обработкой

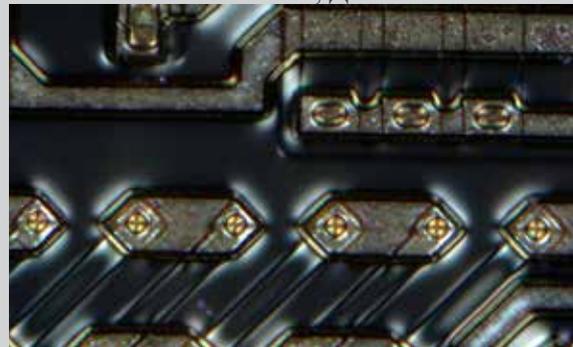
Управление яркостью света

Эргономичный элемент управления расположен справа

Панель с LED индикаторами и ECO режимом



Пластина, ДИК



Пластина, поляризационный свет



Резиновые накладки и защита комфорта пользователя

Оптическая трубка Siedentopf с углом наклона в 45° и межзрачковым расстоянием от 50 to 75 мм

Диоптрийная коррекция +/- 5 диоптрий на обоих окулярах

Окуляры с фиксирующим винтом

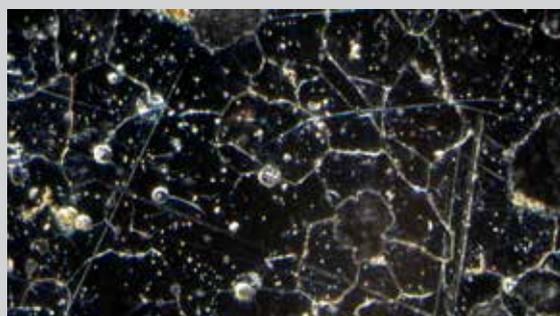


Двухнаправленная поворотная головка, шариковая опора, оснащенная широким наконечником для простоты использования

Фиксирующий винт с ДИК-слайдером

5-ти позиционная поворотная головка позволяет использовать удлинительные кольца

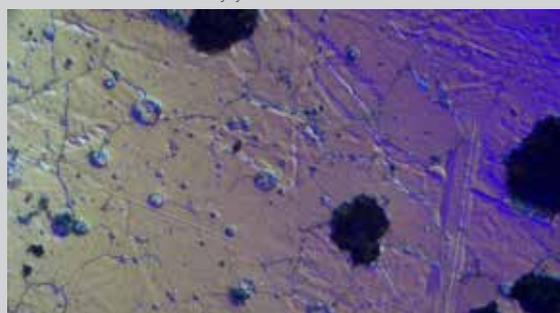
Слайдер фильтров для отраженного света (опционально)



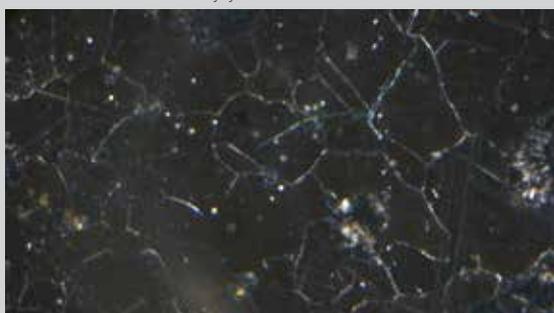
Чугун, Темное поле



Чугун, Светлое поле



Чугун, ДИК



Чугун, Поляризационный свет



Анализатор (поворотный, 360°) и поляризатор

Полевые и апертурные диафрагмы (FS = остановка поля; AS = остановка апертуры)

100W 12V галогеновая лампа с предварительной центровкой

3-х позиционный регулятор оснащен фильтром дневного света

IM-5MET - Технические характеристики

Методы наблюдения	Светлое поле, темное поле, простой поляризованный свет и ДИК Номарского- опционально
Головка	Трикулярная, с углом 45°
Окуляр	Широкоугольные окуляры, PL 10x/24 (Ø 30 mm), вынесенная точка фокусировки с коррекцией диоптрий
Револьверная головка	5x, риверсивная с резьбовым соединением M25 и переходной втулкой (для RMS объективов) слот для ДИК
Объектив	Полностью модульные (см. таблицу с аксессуарами)
Предметный столик	Вращающийся, механический 240x250 мм, 50x50 мм диапазон движения
Фокусировка	Коаксиально, маховики грубой и точной подстройки фокуса
Освещение	100W галоген, с ручной настройкой яркости
Диафрагмы падающего света	Полевая и апертурная диафрагмы
Аксессуары в комплекте	Светофильтры

Аксессуары

Included ■ Optional □

M-880	Широкоугольный, PL 10x/24 (Ø 30 мм), вынесенная точка фокусировки с коррекцией диоптрий	■ ■
M-881	Широкоугольный, PL 10x/24 (Ø 30 мм), с микрометром (10мм/100um), вынесенная точка фокусировки с коррекцией диоптрий	□
M-882	Широкий, WF 15x/16 (Ø 30 мм), с коррекцией диоптрий	□
DC-004	TNT защита размер - 700(длина)x550(высота) мм	■
M-870	Слайдер для ДИК	□
VP-IM5	Протоколы проверки IQ/OQ/PQ	□
15104	Чистящий набор	□

IM-5MET конфигурируется, исходя из потребностей заказчика:

Included ■ Optional □

MET Плахроматы – плоское поле, коррекция на «бесконечность», с большим рабочим расстоянием, field flatness up to F.N. 25:

M-1100	IOS LWD U-PLAN MET objective 5x/0.15	□
M-1101	IOS LWD U-PLAN MET objective 10x/0.30	□
M-1102	IOS LWD U-PLAN MET objective 20x/0.45	□
M-1103	IOS LWD U-PLAN MET objective 50x/0.55	□
M-1104	IOS LWD U-PLAN MET objective 100x/0.80 (dry)	□

MET План-полуахроматической коррекции, с большим рабочим расстоянием, field flatness up to F.N. 25:

M-1171	IOS LWD U-PLAN F MET objective 5x/0.15	□
M-1172	IOS LWD U-PLAN F MET objective 10x/0.30	□
M-1173	IOS LWD U-PLAN F MET objective 20x/0.50	□
M-1174	IOS LWD U-PLAN F MET objective 50x/0.80	□
M-1179	IOS LWD U-PLAN F MET objective 100x/0.90 (dry)	□

MET Плахроматы – плоское поле, коррекция на «бесконечность», с большим рабочим расстоянием, для темного и светлого полей, field flatness up to F.N. 25:

M-1094	IOS LWD U-PLAN MET BD objective 5x/0.15	□
M-1095	IOS LWD U-PLAN MET BD objective 10x/0.30	□
M-1096	IOS LWD U-PLAN MET BD objective 20x/0.45	□
M-1097	IOS LWD U-PLAN MET BD objective 50x/0.55	□
M-1098	IOS LWD U-PLAN MET BD objective 100x/0.80 (dry)	□

MET План-полуахроматической коррекции, с большим рабочим расстоянием, для темного и светлого полей, field flatness up to F.N. 25:

M-1180	IOS LWD U-PLAN F MET BD objective 5x/0.15	□
M-1181	IOS LWD U-PLAN F MET BD objective 10x/0.30	□
M-1182	IOS LWD U-PLAN F MET BD objective 20x/0.50	□
M-1183	IOS LWD U-PLAN F MET BD objective 50x/0.80	□
M-1184	IOS LWD U-PLAN F MET BD objective 100x/0.90 (dry)	□